

株式会社 東レリサーチセンター 先端技術者向けランチョンセミナーのご案内



◆ 日時：2018年9月20日（木）12:00～12:45

◆ 会場：224A（2号館2階）

◆ 演題：

- ・ 電子顕微鏡を用いた最先端デバイスの微細領域評価技術
- ・ 先端半導体デバイス高性能化に向けた積層絶縁膜の評価

※学生・若手研究者向けのランチョンセミナーは同日別会場にて開催します